(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-95197

(43)公開日 平成11年(1999) 4月9日

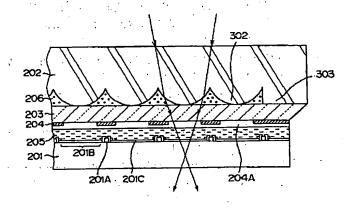
	1/1333 3/00 1/13 1/1335 1/136	酸別記号 500 505 500		F I G 0 2 F G 0 2 B G 0 2 F	1/1335 1/136	•	500 A 505	en ale val ler del J
	ξ.	4	審査請求	未請求 請求	項の数8	OL	(全 8 貝)	最終頁に続く
(21)出願番号	:	特願平9-253845		(71)出願丿	リコー	光学株	式会社	and the
(22)出願日		平成9年(1997)9月18日	,	(no) mans			大畑第十地割	109番地
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	(72)発明和		和博士 		109番地・リコ
		V		,	-		社内	
				(72)発明		昌仙		
	•.				岩手県		大畑第10地割 社内	109番地・リコ
	٠,		•	(72)発明				
·		•						109番地・リコ
	:.					株式会		;
e 1 - 2		Sec. 3		(74)代理	人 弁理士	と 樺山	」亨(外1	
			4			•		最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 液晶プロジェクタ用の液晶デバイスおよび液晶デバイス用の対向基板

(57)【要約】 (修正有)

【課題】液晶デバイスの製造過程における切離しの際に、カケ、クラック、剥がれ等の発生を有効に軽減しうる構造の対向基板を実現する。

【解決手段】光照射側に配備される対向基板であって、 光集束機能を持つ微小な屈折面3.02を、TFT基板2 01における個々の画素に対応させて、片面にアレイ状 に配列形成した屈折面アレイ基板202と、屈折面のア レイ配列に対応するブラックマトリックスアパーチュア 204を形成され、屈折面アレイ基板と熱膨張係数が略 等しい透明材料による平面基板203とを一体化してな り、屈折面アレイ基板の屈折面のアレイが形成された側 の面の、アレイ配列領域の外周部に、屈折面アレイ基板 と平面基板との間隙を保つためのスペーサ部303を、 間隙の大きさが微小な屈折面の高さ以上となるように、 且つ、スペーサ部の外周部が、対向基板の外周端面の一 部をなすように形成した。



【特許請求の範囲】・

【請求項1】液晶プロジェクタ用の液晶デバイスにおいて、TFT基板とともに液晶層を挟持し、光照射側に配備される対向基板であって、

光集束機能を持つ微小な屈折面を、TFT基板における 個々の画素に対応させて、片面にアレイ状に配列形成し た屈折面アレイ基板と、

該屈折面アレイ基板の屈折面のアレイが形成された側の面に配備され、上記屈折面のアレイ配列に対応するブラックマトリックスアパーチュアを形成され、上記屈折面 10アレイ基板と熱膨張係数が略等しい透明材料による平面基板とを一体化してなり、

一体化された基板の一方の外側平面に透明電極膜が形成 され、

上記屈折面アレイ基板の屈折面のアレイが形成された側の面の、アレイ配列領域の外周部に、屈折面アレイ基板と平面基板との間隙を保つためのスペーサ部を、上記間隙の大きさが上記微小な屈折面の高さ以上となるように、且つ、上記スペーサ部の外周部が、対向基板の外周端面の一部をなすように形成したことを特徴とする液晶デバイス用の対向基板。

【請求項2】請求項1記載の液晶デバイス用の対向電極 において、

屈折面アレイ基板に形成された個々の屈折面が凸または 凹のマイクロレンズであることを特徴とする液晶デバイ ス用の対向電極。

【請求項3】請求項1または2記載の液晶デバイス用の 対向基板において、

平面基板は、厚さ: 20μ m~ 250μ mであり、その外周端面に面取りが施され、面取り部の面取り角が略45度~略70度、面取り残量が略 15μ m以上であることを特徴とする液晶デバイス用の対向基板。

【請求項4】請求項1または2または3記載の液晶デバイス用の対向基板において、

平面平板が液晶層の側に配備されることを特徴とする液晶デバイス用の対向基板。

【請求項5】請求項1~4の任意の1に記載の液晶デバイス用の対向基板において、

屈折面アレイ基板と平面基板との間に、所定の屈折率を 持つ透明な媒質を挟むことを特徴とする液晶デバイス用 の対向基板。

【請求項6】請求項5記載の液晶デバイス用の対向基板 において、

透明な媒質が、屈折面のアレイのアレイ配列領域における、屈折面アレイ基板と平面基板との間の間隙部分を満たすことを特徴とする液晶デバイス用の対向基板。

【請求項7】請求項6記載の液晶デバイス用の対向基板 において、

所定の屈折率を持つ透明な媒質が、接合用の接着剤であることを特徴とする液晶デバイス用の対向基板。

2

【請求項8】請求項1~7の任意の1に記載された液晶 デバイス用の対向基板と、TFT基板とにより液晶層を 挾持してなる液晶プロジェクタ用の液晶デバイス。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、液晶プロジェクタ用の液晶デバイスおよび液晶デバイス用の対向基板に関する。

[0002]

【従来の技術】個別的に光の透過状態と遮断状態とを制 御できる液晶画素を2次元に配列してなる液晶デバイス に画像を表示し、この画像に光束を照射し、透過光をス クリーン上に投影結像することにより画像を表示する

「液晶プロジェクタ」が知られている。上記液晶デバイスとして広く知られた「TFT-LCD (Thin Film Transistor Liquid Crystal Device)」は、薄い液晶層を透明な1対の基板で挟持した構成となっている。1対の基板の一方は「TFT基板」と呼ばれ、液晶層に接する側の面に、液晶に対する駆動電界を印加するためのTFT (Thin Film Transistor)が画素配列に従って配列形成されるとともに、これらTFTを駆動するためのバスラインが形成される。TFTとバスラインの形成されない部分は「微小な開口」として2次元的に配列し、個々の開口が「画素」に対応する。

【0003】TFT基板とともに液晶層を挾持する他方 の基板は「対向基板」と呼ばれ、液晶層に接する側の面 に、TFT配列に対する透明な対向電極層と、TFTや バスラインに対して照射光束を遮光するブラックマトリ ックス層(上記画素に対応する開口に応じた開口「ブラ ックマトリックスアパーチュア」) の配列等が形成され ている。このように、TFT-LCDの「1画素に割り 当てられた面積部分」は、TFTやバスライン等により 光の透過しない部分と開口部とからなり、開口部の面積 は「1画素の割り当て面積に対して略40%前後」であ る。このため、TFT-LCDに平行光束を照射した場 合、個々の画素あたり開口部を透過できるのは入射光の 40%程度と小さく、光の利用効率が悪い。光利用効率 を向上させるため、TFT-LCDにおける個々の画素 に対応して凸のマイクロレンズを設け、各マイクロレン ズにより光を対応する画素部分に集光させることが知ら れている。

【0004】ところで、TFT-LCDを製造する際、上記対向基板は一般に、大面積の基板上に多数の基板を配列させてレイアウトし、多数の基板を一括して一体に作製した後、規定の寸法に切り離して1単位(チップ)の対向基板とする。この切断の際に、対向基板を構成する屈折面アレイ基板(前記マイクロレンズのアレイが形成されている)と平面基板のうちで「強度の弱い基板」側に応力集中が生じて「カケ」や「チッピング」が生じることがある。また、対向基板における平面基板の外周

端部は「面取り」されることが多く、この面取りの際にもカケやチッピング、あるいは屈折面アレイ基板と平面 基板とを接合する接着剤の層の剥離が発生することがある。これらカケ、チッピング、接着剤の層の剥離等は液 晶デバイスの動作を妨げるだけでなく、液晶の異常を引き起こす原因となり得る。

[0.005]

【発明が解決しようとする課題】この発明は、液晶デバイスの製造過程における上記切離しの際に、カケ、チッピング、接着剤の剥がれ等の発生を有効に軽減しうる構造の、対向基板の実現を課題とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】この発明の対向基板は 「液晶プロジェクタ用の液晶デバイスにおいて、TFT 基板とともに液晶層を挟持し、光照射側に配備される対 向基板」であって、屈折面アレイ基板と平面基板とを一 体化してなり、以下の特徴を有する(請求項1)。即ち

「屈折面アレイ基板」には、光集束機能を持つ微小な屈 折面が、TFT基板における個々の画素に対応させて、 片面にアレイ状に配列形成される。「平面基板」は、屈 折面アレイ基板と熱膨張係数が略等しい透明材料による 透明材料による平行平板で、屈折面アレイ基板の屈折面 のアレイが形成された側の面に配備され、屈折面のアレ イ配列に対応するブラックマトリックスアパーチュアを 形成され、屈折面アレイ基板に一体化される。一体化さ れた基板の一方の外側平面(液晶層と接する面)には

「透明電極膜」が形成される。屈折面アレイ基板の、屈折面のアレイが形成された側の面の、アレイ配列領域の外周部には「屈折面アレイ基板と平面基板との間隙を保っためのスペーサ部」が形成されるが、このスペーサ部は、上記間隙の大きさが「微小な屈折面の高さ以上」となり、且つスペーサ部の外周部が「対向基板の外周端面の一部をなす」ように形成される。このような構造を取ることにより、前記製造の「切離し工程」において、個々の液晶デバイスは対向基板の「スペーサ部」の部分で切り離されることになる。スペーサ部は「微小な屈折面の高さ以上」の厚さを有し、接合材を介して平面平板と固着されるので、この部分における機械強度が十分に大きくなり、切離しの際に、カケやチッピングの発生が有効に抑制される。

【0007】なお、場合により、屈折面アレイ基板と平面基板との間に、光路長を調整するために「所定の屈折率を有する薄板状の透明部材(「中間構成材」と呼ばれる)が設けられることがあり、このような場合、中間構成材の機械強度が弱いと、切離し工程において中間構成材にカケやクラック等が生じることがある。この場合には、中間構成材が上記スペーサ部と共に切断されるようにすればよい。この場合には中間構成材の外周部も「対向基板の外周端面の一部をなす」ことになる。中間構成材の厚さは、上記スペーサ部と平面基板とで挾まれる部

分で他の部分よりも薄くすることができる。

【0008】屈折面アレイ基板に形成される個々の屈折面は「光集束機能」を有するものであり、この光集束機能は必ずしも、正レンズのように光束を結像させる機能を持つ必要はなく、形状としては「円錐形状」や「截頭円錐形状」が可能である。しかし、光利用効率を最大限に高めるためには、屈折面アレイ基板に形成される個々の屈折面は「マイクロレンズ面」であることができるほか、請求項6記載の発明のように、屈折面アレイ基板と平面基板の間隙部分を「所定の屈折率を持つ透明な媒質」で満たすような場合、上記媒質の屈折率が屈折面アレイ基板の屈折率より高い場合には「凹のマイクロレンズ面」とすることができる。即ち、屈折面は「凸または凹のマイクロレンズ」であることができる(請求項2)。

【O·O O 9】 平面基板の厚さは、20~250 μm、よ り好ましくは30~90μm程度が適当である。前述の 如く、液晶デバイス用の対向基板の、平面基板の外周端 面には「面取り(屈折面アレイ基板の側へ向かって拡が るようなテーパ領域)」が施されるのが一般であるが、 面取り部の「面取り角」は略45度~略70度、「面取 り残量」は略15μm以上であることが好ましい(請求 項3)。上記のような「面取り角・面取り量」で面取り を行うと、面取りの際のカケやチッピング、接合材の剥 離等を有効に防止できる。上記の如き「対向基板」の外 部平面としては、屈折面アレイ基板の面(屈折面のアレ イを形成されていない側の面)と平面基板の面の2面が あり、これら2面のうちで、液晶層の側に成る面に「透 明電極膜」が形成される。このように、透明電極膜は屈 折面アレイ基板の側に形成しても良いし、平面基板の側 に形成してもよいが、一般には、屈折面アレイ基板は平 面基板よりも厚くなりがちであり、屈折面による集束機 能 (焦点距離等) がさほど大きく無いことを考慮すると 「平面平板を液晶層の側に配備する(請求項4)」のが 好ましい。屈折面アレイ基板と平面基板の間には「所定 の屈折率を持つ透明な媒質」を挾むことができる(請求 項5)。上記透明な媒質は「屈折面のアレイのアレイ配 列領域における、屈折面アレイ基板と平面基板との間の 間隙部分」を満たすことができ(請求項6)、この場 合、接合用の接着剤が「所定の屈折率を持つ透明な媒質 を兼ねる」ことができる(請求項7)。

【0010】この発明の「液晶プロジェクタ用の液晶デバイス」は、上記請求項1~7の任意の1つに記載された液晶デバイス用の対向基板と、TFT基板とにより液晶層を挾持して構成される。

[0011]

【発明の実施の形態】図1は、この発明の実施の1形態としての「液晶デバイス」を説明図的に示している。図中符号2.01は「TFT基板」、符号202は「屈折面・

5

アレイ基板」、符号203は「平面基板」、符号205 は「液晶層」を示す。TFT基板201の、液晶層20 5に接する側の面には、各画素を駆動するためのTFT 201Aとバスライン (図示されず) が形成され、これ らTFT201Aとバスラインに覆われていない部分が 「画素」としての開口部201Bになっている。符号2 01Cは「透明導電膜」を示す。TFT基板201と共 に液晶層205を挾持する平面基板203は「透明な平 行平板」で、液晶層205に接する側の面にはブラック マトリックス204が形成され、ブラックマトリックス 204上には透明電極204AがITOにより形成され ている。屈折面アレイ基板202には、平面基板203 に面する側の面に「屈折面」として凸のマイクロレンズ 302のアレイ配列が形成されている。 屈折面アレイ基 板202と平面基板203とは液晶デバイスの「対向基 板」を構成する。

【0012】図1において、照射光束は屈折面アレイ基板203の平坦な面(図の上側面)から入射し、個々の屈折面302に入射して屈折され、ブラックマトリックス204の開口(ブラックマトリックスアパーチュア)を通過し、液晶層205を透過してTFT基板201における「画素」である開口部201Bを通過する。

【0013】屈折面アレイ基板202および平面基板203の材質は、対向基板製作の後工程や熱処理工程で、 屈折面アレイ基板202と平面基板203とが剥離しないように「熱膨張係数が略等しい」ことが必要であるが、この条件が満たされる材料であれば特に制限なく利用できる。

【0014】屈折面アレイ基板202におけるマイクロレンズ形成面と平面基板203の間の間隙部には、光学的には「空気層でも真空層でも」良く、光学的屈折率を有する別の材料を間に挟んでも良い(請求項5)。上記間隙の幅は「数μmから数10μmまで」光学設計で理論的に決まる。この実施の形態では、上記間隙部は接着剤206で満たされている。屈折面アレイ基板202と平面基板203とは接合により一体化される。「接合の材料」は、後工程で処理される加熱温度に耐え得る材料であれば、特に制限はない。対向基板の液晶層の側の面に「後工程で熱処理を施す場合」には、屈折面アレイ基板202と平面基板203との間隙部は「真空層とするか別の材料を挟むこと」が好ましい。上記間隙部を空気層とすると、熱処理の際に空気層が膨張するからである。

【0015】図2に屈折面アレイ基板202を示す。符号303は「スペーサ部」を示す。「h」は、スペーサ部303の(マイクロレンズ302形成面からの)高さを示し、「h'」はマイクロレンズ302の高さを示している。h,h'は関係:h \geq h'を満たすことが必要である。即ち、スペーサ部303は、個々のマイクロレンズ302の高さ以上の高さに形成されている。

6

【0016】図3は、図1に示した液晶デバイスの「対向基板」を説明図的に示している。符号202は「屈折面アレイ基板」、符号303は「スペーサ部」、符号350は屈折面アレイ(マイクロレンズアレイ)の「アレイ配列領域」を示している。即ち、屈折面としてのマイクロレンズのアレイは、このアレイ配列領域350にアレイ配列領域305の外周部」にアレイ配列領域305を囲繞するように形成され、符号304で示す「切断部」に至るまで形成されている。図3に符号203Aで示す「ハッチを施した部分」は、平面基板203の外周端部の「面取りされた部分(以下「面取り部」という)を示している。

【0017】図4は、図3に示した対向基板の「端部近 傍の状態」を示している。符号206は「接着剤(接合 の材料)」、符号203Aは面取り部、符号304は切 断部(前記「切離し工程」で切断された面)を示す。図 $4に示す角: \thetaは「面取り角」で、「d」は「面取り$ 量」、平面基板203の厚さを「D」とすると、面取り 残量: tは「D-d」である。図4では、接着剤206 の層により、屈折面アレイ基板202と平面基板203 の間は完全に満たされているが、前述したように、マイ クロレンズ形成面とこれに対向する平面基板面との間隙 部を真空層とし、外周部(スペーサ部)のみに接着剤を 挾んでも良い。図4に示すように、平面基板203の外 周端部は面取りされるが、面取りは平面基板203の厚 みの一部を残すように行われ、接着剤206の層までは 行われていない。即ち、接着剤6の層は、マイクロレン ズアレイを形成した屈折面アレイ基板202の端面と同 様に「光入射面に対して直角」に切り離されている。図 4に示すように、上記切断部304は「対向基板の外周 端面」を成すが、スペーサ部303の外周部は「対向基 板の外周端面の一部」をなすことになる。

【0018】即ち、上に説明した実施の形態において 「対向基板」は、液晶プロジェクタ用の液晶デバイスに おいて、TFT基板201とともに液晶層205を挾持 し、光照射側に配備される対向基板であって、光集束機 能を持つ微小な屈折面302をTFT基板201におけ る個々の画素に対応させて、片面にアレイ状に配列形成 した屈折面アレイ基板202と、該屈折面アレイ基板2 02の屈折面302のアレイが形成された側の面に配備 され、屈折面のアレイ配列に対応するブラックマトリッ クスアパーチュアを形成され、屈折面アレイ基板202 と熱膨張係数が略等しい透明材料による平面基板203 とを一体化してなり、一体化された基板の一方の外側平 面に透明電極膜204Aが形成され、屈折面アレイ基板 202の屈折面のアレイが形成された側の面の、アレイ 配列領域350の外周部に、屈折面アレイ基板と平面基 板との間隙を保つためのスペーサ部303を、上記間隙 50 の大きさが、微小な屈折面302の高さ以上となるよう

7

に、且つ、スペーサ部303の外周部が、対向基板の外 周端面304の一部をなすように形成したもので(請求 項1)、屈折面アレイ基板に形成された個々の屈折面3 02は「凸のマイクロレンズ」であり(請求項2)、平 面基板203の外周端面に「面取り」が施され、平面平 板203は、液晶層205の側に配備され(請求項 4) 、屈折面アレイ基板202と平面基板203の間 に、所定の屈折率を持つ透明な媒質206が挟まれ(請 求項5)、この透明な媒質206は、屈折面のアレイの アレイ配列領域350における、屈折面アレイ基板20 2と平面基板203との間の間隙部分を満たす「接合用 の接着剤」である(請求項6,7)。そして、上記液晶 デバイスは、上記の如き対向基板と、TFT基板201 とにより液晶層205を挾持してなる液晶プロジェクタ 用の液晶デバイスである。この「液晶デバイス」は勿 論、モノクロ画像表示用に使用できるが、カラー画像を 表示するためのR (赤), G (緑), B (青) 画像の任 意のものを表示するものとして使用することができる。 即ち、この液晶デバイスを3個用い、その個々にR, G、B画像を表示することにより、液晶カラープロジェ クター用の画像表示手段を構成することができる。 [0019]

【実施例】以下、具体的な実施例を挙げる。図1~図4 に即して説明した液晶デバイスを以下のように実施した。

【0020】図3を参照すると、屈折面アレイ基板202は、ネオセラムN-0材料(d線に対する屈折率: nd=1.541)のもので、横方向(長手方向)長さ:27.4mm、縦方向長さ:19.85mmであり、符号350で示す「アレイ配列領域(横方向:18.582mm、縦方向:14.022mm)」にマイクロレンズ302をアレイ配列形成されている。有効領域350の外周部に形成されたスペーサ部303は4角形状をなして有効領域350を囲繞し、その幅は1.2mmである。(図3には示されていないが、実施例では、図2あるいは図4に示されたように、マイクロレンズの配列領域とスペーサ部との間に「レンズ底面と同じ高さの領域」が四角い枠状に設けられており、このためスペーサ部の幅は上記の幅になっているのである。

【0021】平面基板203は厚さ:60μmのネオセラムN-0材料の平行平板である。屈折面アレイ基板202と平面基板203とを接合する接着剤206の層は両基板間の間隙を満たす。接着剤206は「フッ素系の低屈折率接着剤」である。平面基板203の他方の面の、ブラックマトリックス204はCr膜により、透明電極膜204AはITO膜により形成した。ブラックマトリックス204のCr膜面には、その外周部にアライメントマークを形成し、TFT基板201との位置合わせに用いた。ブラックマトリックスの開口部である前述の「ブラックマトリックスアパーチュア」は長方形形状

8

であり、マトリックスとしては「碁盤目状」に配列され、個々のアパーチュアは横幅: 23.0μ m、縦幅: 18.5μ mで、配列ピッチは横方向ピッチ: 28.5μ m、縦方向ピッチ: 28.5μ mで、対角方向の長さは 40.305μ mである。

【0022】屈折面アレイ基板202に形成された「屈折面」であるマイクロレンズ302の個々は、4角形形状の領域(形状や寸法は、液晶デバイスにおける画素の寸法やピッチにより決定される)を底面形状として形成した。アレイ配列をなすマイクロレンズ302は、レンズ高さ:8.28 μ m(図2の高さ:h')の凸レンズであり頂部近傍は球面形状で、焦点距離は190 μ mである。スペーサ部303の高さ:h(図2)は、各マイクロレンズ302の頂点より僅かに高い高さ: 10.30μ mになっている。上記マイクロレンズにより集光される光束は、平面基板を透過して、ブラックマトリックス部分の僅か先に集光する。平面基板203の厚みをなす「外周端面」には面取りを施した。このような構成を持つ対向基板は、TFT基板201と共に液晶層205を挟持し全体として一体化される。

【0023】以下、上記実施例におけるの対向基板の製 造方法を説明する。厚さ:1 mm、直径:8 インチのネ オセラムN-0基板を屈折面アレイ基板用の材料とし て、この基板に上記平面寸法 (27.4mm×19.8 5 mm) を持つ、30個分の「屈折面アレイ基板」をレ イアウトした。即ち、先ず、上記ネオセラムN一〇材料 基板上にCr膜を厚さ:5000Åにスパッタリング し、マスクを用いたウエットエッチングにより、スペー サ部 (隣接する屈折面アレイ基板のスペーサ部とつなが) っている) に該当する部分のみを残してCr膜を除去す る。マスクはフォトハブリケーション法で形成したが、 スパッタリングでクロムを成膜する際に、スペーサ部以 外を金属マスクで遮蔽して形成しても良い。次に、熱可 塑性感光性材料としてフォトレジストを塗布し、パター ニングにより個々のアレイ配列領域において、マイクロ レンズの底面領域となる前記4角形形状ごとにフォトレ ジストが残るようにした。このようにして、横長4角形 形状のフォトレジストのアレイ配列がアレイ配列領域ご とに得られる。上記フォトレジストを熱変形し、個々の フォトレジストの表面を「凸曲面」化し、高さ:12. 5 2 5 μ mの所望のレンズ形状を形成した。この時の形 状は、底面形状が横長4角形で断面形状が球形状であ る。

【0024】続いて、大口径のリジターノコイルを用いた大口径ECRプラズマエッチング装置で全体として「1よりもわずかに大きい」選択比で12. 7μ mエッチングし、ネオセラムN-0材料基板表面に、レンズ高さ:9. 28μ m(図2の高さ:h')の凸のマイクロレンズのアレイ配列を形成し、更に、僅かに 2μ mほどオーバーエッチングする。

9

【0025】スペーサ部となるべき部分は、Cr膜のマ スク作用でエッチングされずに残るので、マイクロレン ズアレイ形成後に上記Cr膜を除去すると、スペーサ部 303の高さ:hは、各マイクロレンズ302の頂点よ り僅かに高い高さ:10.30μmになる。マイクロレ ンズアレイとスペーサ部とが形成された面の全面に、接 着剤としてフッ素系の低屈折率接着剤を塗布し、その上 から平面基板となるべき、厚さ:60μmのネオセラム N-0材料(直径:8インチ 平行平板)を乗せ、上記 接着剤を紫外線硬化し、その後、厚さ:60μmの平行 10 平板(平面基板)の他方の面に各対向基板ごとの透明電 極やブラックマトリックスを形成した。屈折面基板にな る平行平面板も平面基板となるべき平行平板も同じネオ セラムN-0材料であるため、熱膨張係数が等しく、T FT-LCDを製作するための工程での熱処理工程の際 の応力による破壊の問題が無い。この状態から、個々の・ 対向基板のチップを、ダイシングマシーン等を使用して 切離し、次いで、切り離された個々のチップにおける平 面基板の外周端面に面取りを行う。この切り離し、面取 *

*りの際、切断面部分(図4に符号304で示す部分) や、この部分と面取り部(図4に符号302Aで示す部 分)との境界で「カケやチッピング、接着剤の剥がれ」 が発生する問題がある。この発明においては、スペーサ 部を屈折面部分以上の高さにし、このスペーサ部(厚さ が大きいことで物理強度が大きい)で切り離しを行うこ とにより、切断面部分で「カケやチッピング」が発生す るのを有効に防止している。面取り部におけるカケ、チ ッピング、接着剤の剥離を防止するため、「面取り角 (切り離しの際に切断された垂直切断面と面取り面のな す角度: 図4における角: θ)」を略45°~略70 度、「面取り残量:図4の厚さ:t)」を略15μm以 上とした。上記「面取り角度: θ」「面取り量: d」 「面取り残量:t」、「ダイヤモンド粒径(面取りに用 いられるダイヤモンド粒の径): Δ」と「チッピング (接着剤のカケの発生を含む)」の関係を調べた実験の 結果を一覧にして以下に示す。

[0026]

実験:1 平面基板の厚さ:D=60μm

				,		
	θ (度)	d (μm)	Δ	チッピング	t (μm)	評価
	,		粒径番号	´量(μm)		
.1	4 0	4 5	400	7 0	1 5	· ×
2	40	5 0	400	8 0	1 0	×
3	['] 4 5	4 0	360	4 0	2 0	Δ
4	4 5	4 5	360	5 0	1 5	Δ
5	4 5	5 0	. 360	7 0	1 0	×
6	45	5 5	360	110	5	×
7.	4 5	60	. 360	1 3 0	0 :	4 - X, 5
8	4 5	4 0	400	2 0	2 0	0
9	4 5	4 5	400	3 0	1 5	´ , O
10	4 5	5 0	400	5 O	10	×
11	4 5	5 5	400.	8.0	5	×
12	4 5	6 Ò	400	100	0	×
13	6 0	3 5	400	1 0	2 5	0
14	60	40 `	400	2 0	2 0	0
15	6 0	4 5	400	3 0	· 15	0
16	· 6 0	50	400	5 0	10	Δ
17	6 0	5 5	400	9 0	5	×
18	6 0	6 0	400	100	0	×
19	70	4 0	400	1 5	2 0	0
20	70 .	4 5	400	2 0	15	0
21	7 0	5 0	400	40	1 0	\triangle
22	7 0	· 55	400	7 0	5	×

チッピング:接着剤のカケの発生を含む。顕微鏡観察にて実施した。評価:顕微鏡観察にてカケ、チッピング、接着剤の剥離、カバーガラスのカン等の状況によって、次の3段階で評価した。〇:良好、Δ:少ないが発生する、×:数多く発生する。

[0027]

実験: 2 平面基板の厚さ: D=35μm

	11					12
	θ (度)	d (μ m)	Δ	チッピング	t (μm)	評「価
			粒径番号	虛 (μm)		
1	4 5	1 5	400	2 0	2 5	0
2	4 5	2 0	400	3 0	15.	0
3	4 5	2 5	400	:50	1 0	×
4	4 5	3 0	400	8 0	5	×
5.	6 0	1 0	400	2 0	2 5	0
6	6 0	15	400	3 0	2 0	. O
7	60	2 0	400	4 0	1 5	0
8	6 0	2 5	400	60.	. 10	Δ
9.	60	3 0	400	100	5	×
10	7 0	· 10	400	2 0	2 5	Ο,
11	7 0	1 5	400	3 0	20	0
12	7 0	2 0	400	3 5	15	0
13	7 0	2 5	400	6 0	1 0	Δ
14	7 0	3 0	400	9 0	5,	, ×

これらの結果から、面取り残量: t を大きく(15μ m 以上)すること、面取り角を45度~70度の範囲にするのが良いことがわかる。なお、平面基板の面取り残量を大きくしすぎると、フルカット時の切断ブレードへの負担が大きくなり、面取り量以上のチッピングが発生する。従って、面取り残量は、平面基板の材料と成る平行平板の厚みに応じて制御する必要があり、平面基板の厚さが 250μ mであるときには、面取り残量は 150μ m以下とする必要があった。

【0028】上述のように、マイクロレンズの高さに比べてスペーサ部の高さが高いので、屈折面アレイ基板と平面基板とはスペーサ部で接触し、スペーサ部を切断部として切り離しを行い、面取り残量: tを大きく、且つ、面取り角度を略45度~70度にしたため、面取り部が接着剤の層に至ることがなく、チッピング量が少なくかつ接着剤の層の剥離がなくなった。上記の方法で製作した対向基板は十分な機械強度が得られた。

【0029】別途製作したTFT基板と上記のようにして得られた対向基板とで液晶層を挟持して液晶デバイス(TFTLCD)を形成し、入射角:0±8.6度の範囲で照射光束(平行光束)を照射したところ、63.2%以上の光利用効率を実現できた。屈折面を用いない場合の光利用効率:48.12%に対し、略1.31倍に光利用効率が向上した。

[0030]

【発明の効果】以上に説明したように、この発明によれば液晶プロジェクター用の新規な液晶デバイスおよび液晶デバイス用の新規な対向基板を実現できる。この発明の対向電極は上記の如き構成となっているので、対向基板の製造過程におけるチップの切離しの際に、カケ、クラック、接着剤の層の剥がれの発生を有効に軽減でき、従って、対向基板の歩留まりが向上し、対向電極の生産性・信頼性を向上せしめて、対応基板の生産コストを低減させることができる。またこの発明の液晶デバイスは、上記の如き対向基板を用いて構成されることにより、安価に製造でき、しかも信頼性が高い。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の液晶プロジェクター用の液晶デバイスの実施の1形態を説明するための図である。

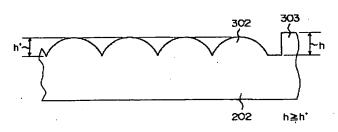
【図2】上記実施の形態における屈折面アレイ基板を説明するための図である。

【図3】上記実施の形態における対向基板の平面図的な 説明図である。

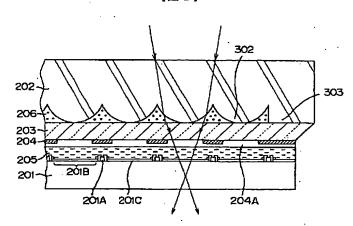
【図4】図3におけるIII-III 断面図である。 【符号の説明】

202	屈折面アレイ基板
203	平面基板
302	マイクロレンズ
303	スペーサ部
206	接着剤

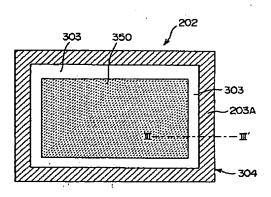
【図2】



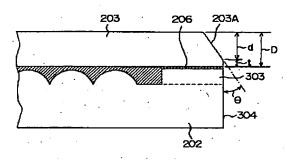




【図3】



【図4】



11-11 断面図

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

総別記号

G09F 9/00

2 2 7

FΙ

G09F 9/00

3 2 7 Z

(72)発明者 山崎 善之

岩手県花巻市大畑第10地割109番地・リコ

一光学株式会社内